LENS DEFECT INSPECTING INSTRUMENT

Publication number: JP61096439 Publication date: 1986-05-15

Inventor: SHIN

SHINDOU YOUKOU; HAMA MASANOBU

Applicant: TOF

TORAY INDUSTRIES

Classification:
- international:

G01M11/00; G01M11/02; G01M11/00; G01M11/02;

(IPC1-7): G01M11/00

- European:

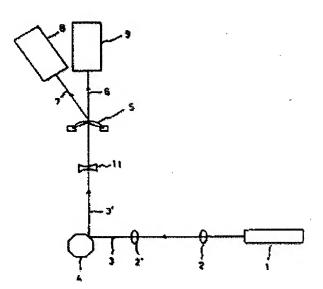
G01M11/02D

Application number: JP19840216334 19841017 Priority number(s): JP19840216334 19841017

Report a data error here

Abstract of JP61096439

PURPOSE:To coincide with the visual inspection standard of which the center part is made higher and the outer peripheral part coarser by arranging the lens enlarging the light amplitude toward the outer peripheral part side from the center part of the lens to be inspected between a scanning device system and the lens to be inspected. CONSTITUTION: The beam amplitude enlarging lens 11 enlarging the beam amplitude of a scanning means 3' toward the outer peripheral part side from the center part of the lens 5 to be inspected is arranged between the scanning device system 4 consisting of rotary polygon mirrors or the vibrating mirror scanning a laser beam 3. If there is any defect, then, the absorbed and reduced transmitted beam 6 and scattered beam 7 are detected by detectors 8, 9 respectively and the existence of defects is examined by the change in the detected quantity. The beam amplitude is accordingly made bigger as the outer peripheral part of the lens 5 to be examined and the small defect of the center part is not overlooked and the defect of the outer peripheral part is overlooked and the detecting accuracy of defects can be made higher as the center part.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

四公開特許公報(A)

昭61-96439

@lnt_Cl_4 G 01 M 11/00

識別記号

庁内整理番号 L-2122-2G 母公開 昭和61年(1986)5月15日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称

レンズ欠点検査装置

②特 願 昭59-216334

塑出 願 昭59(1984)10月17日

の発明者 進藤 の発明者 溶

Ho see

大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

⑪出 顋 人 東レ株式会社

東京都中央区日本祗室町2丁目2番地

107.11.13 OA

剪 額 實

1. 强明の名称

レンズ欠点役査装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本 危 明 は 、 光 学 レ ン ズ の 扱 面 お よ び 内 部 に 介 在 する キ ズ 、 異 物 等 の 欠 点 の 有 紅 を 検 出 する レ ン ズ 欠点検査技能に関するものである。 【従来の技術】

一般に光学レンズのキズ、アツなどの欠陥は 23 親した枝変 員の目視により 実施されているのが 実状である。 したがって、 検変 員の違い、 疲労 度の違い をによる 検査 結果の パラツキは 遊けられない、

一方、透明体の光学レンズの表面および内部に 介在する欠点の検査方法としてレーザフライング スポット法がある。

このレーザフライングスポット法は、第6図に示すように、レーザ光源1からでたレーザ光をレンズ系2、2,により所変のレーザ光3とし、これを仮動ミラー、あるいは、回転多面積よりなるスキャニング技程系4により一定方向に連続的にスキャニングさせる。

このスキャニングされたスキャニング光3'をこのスキャニング光3'と交叉する方向に一定速度で移動する故僚レンズ5上に照射すると、故様レンズ5に含まれる父解10により吸収されて妖光した透光光6と、故様光7とになる。この遺場

特開昭61-96439(2)

光6を受光器 8 で、また散乱光 7 を受光器 9 で受光 し、その受光量変化を検出することによって被検レンズ 5 中の欠陥の有無を検査することができる。

(発明が解決しようとする問題点)

光学レンズ、特に 頭頭 レンズの検査 基準は、その必要目的からしてレンズの中央部分の指揮が高くなっているのが従来の目視検査の基準である。

すなわち、レンズの中央部と外周部では、許容される欠点の大きさ、数を異にしている。つまり目扱する部分であるレンズの中央部では、欠点を厳しくチェックし、目視しないレンズの外周部では許容される欠点を概くしても殆ど差支えないのである。レンズの中央部、外周部とも同一基準で検査をすると、不良品と判断される製品の数が増え、生産効率が極めて感くなる。

上記したフライングスポット法の検査装置においては、回転多面積から出るレーザのスポット径 (光幅)が一定であるため(レーザ光幅は、目的 に応じて色々設計可能であり、一般的には50 μ

外周郎側に向って拡大する光橋拡大シンズを配置せしめたことを特徴とするシンズ欠点後査装置である。

以下本発明を図面に終づき更に詳しく説明する。 第1回は、本発明に係るレンズ欠点検査装置の 一実施例を示す係収図である。

被様レンズ 5 に欠陥 1 0 が存在する場合、欠陥 1 0 により吸収されて減光した透過光 6 を受光質 あるいは100μ等のビーム幅を選択して使用される)、被後レンズの外周部、内周部の区別なく、同一条件で欠点の大きさ、数を判別、検出してしまう。

本発明の目的は、光学レンズの検査精度を従来の目視検査処理に合及させるレンズ欠点検査装置 を促供せんとするものである。

(問題点を解決するための手段および作用)

本発明は、上記の目的を選成するために次の代 成を有するものである。

8 で、また散乱光7 を受光器9 で受光し、その受 光量変化を依出することによって被後レンズ5 中 の欠陥の有無を検査するものである。

第2図(イ)は、レンズに気泡があった場合の 散乱光の出現による光度変化を示す図であり、第 2図(ロ)は、レンズに異物があった場合の透過 光の減衰による光量変化を示す図であり、それぞ れ機動は、被検レンズを、その中心位置をすらす ことなく380度回転させたときの時間に相当す

取3図は、第6図に示す光幅拡大レンズ11を配置しない従来のレーザフライングスポット法による被係レンズ上のレーザ光の透過パターンを示すものである。

第3 図に示すように、促来の被検レンズ上の認 週パターンは、前にも述べたように、被検レンズ の中央部、外周部ともレーザ光幅が一定であるた め、中央部および外周郎とも同一条件で欠点の大 きさ、数を判別、優化してしまう。

被校レンズ上の小さな欠点を検出するには、相

特開昭61-96439 (3)

いレーザビームを当てることによりビームの変化 量を大きく捉えることができ、逆に小さな欠点に 大きな幅のビームを当てても、ビームの変化曲が 少なく、欠点を見遊してしまうことになる。

第4 図は、本発明に適用される光幅拡大レンズ 1 1 の一実施銀様を示す外観図であり、レンズの中央部は厚みが小さく、両端に向って擴大厚くなるように加工されている。

第1回は、本発明に係るレンズ欠点検査装置の 一実施例を示す構成図である。

第2図(イ)は、レンズに気泡があった場合の 散乱光の出現による光型変化を示す図であり、 第 2図(ロ)は、レンズに異物があった場合の透過 光の球疫による光量変化を示す図である。

第3 図は、第6 図に示す光幅拡大レンズ 1 1 を配置しない 従来のレーザフライグスポット 法による 独校レンズ上のレーザ光の透過パターンを示す ものである。

第4回は、本発明に適用される光幅拡大レンズの一支施低級を示す外級回であり、第5回は、第4回の光幅拡大レンズを使用した際の本発明に係る故様レンズ上のレーザ光の返過パターンを示す ものである。

第6回は、提来のレーザフライングスポット法によるレンズ欠点投查装置の構成図である。 図面中の符号の説明

1…レーザ光額

2、2′ …レンズ系

3 … レーザ光

3′ …スキャニング光

変えることにより光橋Wを紙々遊択することが出来る。

なお、光幅拡大レンズとして上記においては、 レンズの中央部と外周部とで呼みの異るものを例 示したが、これに限定されることなく、外周部の レーザビームをほかすようなフィルター的な役割 をするようなものを採用してもよい。

(発明の効果)

すなわち、被検レンズ5を透過するレーザ光穏 Wが、レンズの中央部と外周部とで異なるため、 欠点の検出特度がレンズの中央部ほど高く、外周 部ほど小さくなる。

4 -- スキャニング装置系

5 一被役レンズ

6 -- 透没光

7 … 故 乱 光

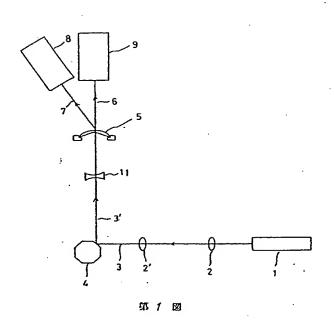
8 -- 波選光受光器

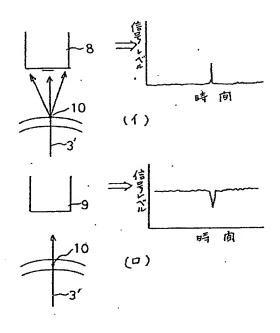
9 一 做 乱 光 受 光 器

0一欠陷

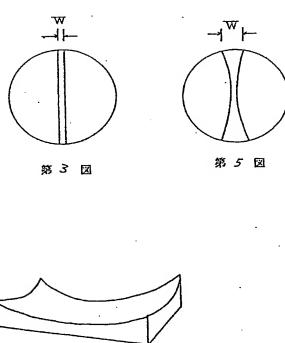
11… 光穏拡大レンズ

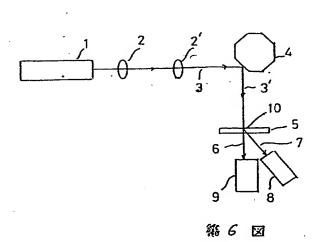
特許出額人 東 レ 株 式 会 社





第2図





第4 図

-218-

11/9/2007, EAST Version: 2.1.0.14

PAT-NO:

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP361096439A

JP 61096439 A LENS DEFECT INSPECTING INSTRUMENT

PUBN-DATE:

May 15, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHINDOU, YOUKOU HAMA, MASANOBU

ASSIGNEE-INFORMATION: NAME TORAY IND INC

COUNTRY

APPL-NO:

JP59216334

APPL-DATE:

October 17, 1984

INT-CL (IPC): G01M011/00

US-CL-CURRENT: 356/124.5

ABSTRACT:

PURPOSE: To coincide with the visual inspection standard of which the center part is made higher and the outer peripheral part coarser by arranging the lens enlarging the light amplitude toward the outer peripheral part side from the center part of the lens to be inspected between a scanning device system and the lens to be inspected.

CONSTITUTION: The beam amplitude enlarging lens 11 enlarging the beam amplitude of a scanning means 3' toward the outer peripheral part side from the center part of the lens 5 to be inspected is arranged between the scanning device system 4 consisting of rotary polygon mirrors or the vibrating mirror scanning a laser beam 3. If there is any defect, then, the absorbed and reduced transmitted beam 6 and scattered beam 7 are detected by detectors 8, 9 respectively and the existence of defects is examined by the change in the detected quantity. The beam amplitude is accordingly made bigger as the outer peripheral part of the lens 5 to be examined and the small defect of the center part is not overlooked and the defect of the outer peripheral part is overlooked and the detecting accuracy of defects can be made higher as the center part.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO& Japio